

к приказу НИЦ «Курчатовский институт»
от «25» 12 2025 № 5243

Перечень оборудования
содержащий наименования и основные характеристики приборов,
наименование производителя, а также сведения о метрологическом
обеспечении средств измерений
Центра коллективного пользования
«Аналитический центр исследований электронной компонентной базы
НИЦ «Курчатовский институт»

| № п/п | Наименование оборудования | Фирма, страна, год производства | Инвентарный номер | Назначение оборудования | Метрологическое обеспечение средств измерений |
|-------|---|--|-------------------|--|---|
| 1 | Волнодисперсионный спектрометр IncaWave 700 | Oxfordinstruments, Великобритания, 2008 г. | СТ2899 | Количественный анализ высокого разрешения элементного состава образцов, картирование поверхности образцов. | Методики измерений. Эталоны. |
| 2 | Вторично-ионный масспектрометр САМЕСА ВИМС IMS-4f | САМЕСА, Франция, 1990 г. | СТ1471 | Анализ твердофазных материалов методом масс-спектрометрии. Прибор позволяет проводить элементный и изотопный анализ образцов, в том числе профилирование по глубине (послойный анализ) наногетероструктур. | Методики измерений. |

| № п/п | Наименование оборудования | Фирма, страна, год производства | Инвентар ный номер | Назначение оборудования | Метроло гическое обеспе чение средств измерений |
|----------|---|--|--------------------------|---|---|
| 3 | ИК-Фурье спектрометр Spectrum 100 | PerkinElmer, Соединенные Штаты Америки, 2008 г. | СТ2898 | Качественный и количественный анализ органических веществ в средней ИК- области, идентификация по сравнению с базами данных | Средством измерений не является. |
| 4 | Приставка INCA ENERGY- 350 к растровому микроскопу | Oxfordinstruments, Великобритания, 2005 г. | СТ2885 | Количественный анализ элементного состава образцов и картирование поверхности образцов. | Методики измерений. |
| 5 | Просвечивающий электронный микроскоп Теснаі G220 | FEI, Соединенные Штаты Америки, 2007 г. | СТ2897 | Структурный и элементный анализ высокого разрешения твердотельных образцов и структуры границы раздела слоев. | Методики измерений. Эталоны. |
| 6 | Растровый Оже- микроанализатор PHI-660 | PerkinElmer, Соединенные Штаты Америки, 1993 г. | СТ2802 | Количественный анализ элементного состава приповерхностн ого слоя образцов в нанометровом диапазоне, профильный анализ нано- гетероструктур. | Методики измерений. Эталоны. |

| № п/п | Наименование оборудования | Фирма, страна, год производства | Инвентар ный номер | Назначение оборудования | Метроло гическое обеспече ние средств измерений |
|----------|--|---|--------------------------|--|---|
| 7 | Растровый электронный микроскоп CAMSCAN-s4 | CambridgeInstrum ents, Великобритания, 1988 г. | СТ2876 | Исследование морфологии образцов, элементного состава и картирование поверхности образцов, путем использования двух приставок: ВДП и ЭДП | Методики измерений. Эталоны. |
| 8 | Сканирующий Зондовый Микроскоп Solver PRO-M | ООО «НТ-МДТ», Россия, 2005 г. | СТ2884 | Профильный анализ твердотельных образцов. Исследование морфологии поверхности образцов. | Методики измерений. Эталоны. |
| 9 | Профилометр ALPHA-STEP 200 | KLA-Tencor, Соединенные Штаты Америки, 1989 г. | СТ2803 | Профильный анализ твердотельных образцов. | Методики измерений. Эталоны. |